80 MeV Xe イオンを照射した高温超伝導体に形成される 柱状欠陥構造の照射方向依存性

Direction-dependent Morphologies of Columnar Defects in High-Tc Superconductors

Irradiated with 80 MeV Xe Ions

熊大工¹, 東北大金研², 関学大理工³, 住重アテックス(株)⁴, 原子力機構⁵

^O末吉哲郎¹, 千星聡², 尾崎壽紀³, 坂根仁⁴, 石川法人⁵

Kumamoto Univ.¹, Tohoku Univ.², Kwansei Gakuin Univ.³, SHI-ATEX Co., Ltd.⁴, JAEA⁵

°Tetsuro Sueyoshi¹, Satoshi Semboshi², Toshinori Ozaki³, Hitoshi Sakane⁴, Norito Ishikawa⁵

E-mail: tetsu@cs.kumamoto-u.ac.jp

1. はじめに

高温超伝導体に対するイオン照射を用いた ピン止め点の導入は,試料作製過程と独立に形 状,密度,欠陥方向の制御を行うことができる ため,磁束ピン止め構造の最適化を効率的に行 うことが期待できる.我々は,これまで高温超 伝導体に対して低エネルギーの重イオン照射 を行うことで, c軸方向に不連続な柱状欠陥を 導入し,連続的な柱状欠陥より高い臨界電流密 度(高J。)を示すことを報告している[1].一方, c軸方向で不連続となる柱状欠陥の構造は, c 軸から45°傾けた同じエネルギーのイオン種の 照射では連続的な柱状欠陥の形成となること も明らかにした.

本研究では、高温超伝導体に対してイオン照 射を用いて任意の方向に不連続な柱状欠陥を 導入する手段を確立するための第1段階とし て、*c*軸方向に不連続な柱状欠陥を形成するこ とができる 80 MeV の Xe イオンビームを、*c* 軸から 20°, 45°, 85°と傾けて高温超伝導線材に 照射し、その照射欠陥構造について調べた.

2. 実験および結果

照射試料には、フジクラ製の GdBCO テープ 線材(5cm 幅, 膜厚 2.2 μ m, $I_c = 280$ A)をフォト リソグラフィにより長さ 1 mm, 幅約 40 μ m の ブリッジに加工して用いた. 80 MeV の Xe イ オン照射は、原子力機構のタンデム加速器にお いて行われた. c 軸方向に形成される照射欠陥 と直接比較できるように、同一試料において c軸方向と c 軸に対して± θ (= 20°, 45°, 85°)の 3 つの角度で照射を行った. 各方向の照射量は、 2.42×10¹⁰ ions/cm² (マッチング磁場 B_{ϕ} =0.5 T) である. 照射欠陥の微細構造の観察は、透過型 電子顕微鏡(TEM)による断面像観察を通して 行った.

Fig.1 に, $\theta_i = 0^\circ$, ±20°の角度で照射した試料

の断面 TEM 像を示す. 試料表面付近では, c 軸 方向に沿って, 不連続な構造の柱状欠陥の形成 を確認できる. 高温超伝導体における柱状欠陥 の形状は, イオン照射時の電子的阻止能 S_e の 値に影響される[2]. 80 MeV Xe イオン照射で は, $S_e \sim 20$ keV/nm であり, これは Y 系高温超 伝導線材の c 軸方向に不連続な柱状欠陥の形 成が報告されている 74 MeV Ag イオン照射で の $S_e \sim 19$ keV/nm の値とほぼ一致している[3]. 一方, 照射方向が c 軸から 20°傾いて形成され る柱状欠陥は, c 軸から 45°傾いて照射した場 合[1]と同様に, 表面付近では試料を貫通する ような連続的な構造になっている.



Fig.1 Cross-sectional TEM image of the GdBCO coated conductor irradiated with 80 MeV Xe ions at $\theta_1 = 0^\circ$ and $\pm 45^\circ$ relative to the *c*-axis.

謝辞

本研究の一部は,原研タンデム加速器施設供用 利用制度,および科研費(19K04474)の助成を 受けて実施したものである.

参考文献

- [1] Sueyoshi et al. JJAP 59 (2020) 023001.
- [2] Zhu et al., PRB 48 (1993) 6436.
- [3] Strickland et al. Physica C 469 (2009) 2060.